

第84回分析基礎セミナー

実践！機器分析【6】

表面分析

【日時】 2014/7/9 (水) 13:00-17:00 (受付12:30より)

【場所】 九州大学伊都キャンパス・西講義棟 3階第3講義室

【主催】 九州大学中央分析センター伊都分室

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社堀場製作所、株式会社島津製作所

13:00-14:30 「XPS分析の基礎と応用」

大気と接する極表面はバルクとはまた違った世界が広がっています。原理的に最表層から数ナノメートルまでの情報しか取ってこないXPS分析は、それを解き明かす有力な手法の一つと言えます。ケミカルシフトを読み解くことで単なる元素分析だけでなく、表面の化学結合状態をも推測することができます。XPS分析の基礎から応用を解説していきます。

14:35-15:25 GDSの基礎と実際

表面皮膜に対する評価方法の1つとしてグロー放電発光分析 (rf-GD-OES) を用いて深さ方向の元素プロファイル情報を得ることができます。本講演ではrf-GD測定装置の原理と応用例を紹介します。

15:30-17:00 「電子線マイクロアナリシス (EPMA) の基礎」

電子線マイクロアナリシス (EPMA) の原理・構造及び各種分析手法とその分析実例を紹介します。

今年度は、基礎に加えて実際にデータを取得する上で役立つ内容に重点をおきます。現場で困っている方、よりよいデータを取得されたい方にも有用です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力お願いします。途中入退室も自由ですのでご都合に合わせてご参加ください。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 Tel.092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp